

## МИШЕНИ ВИДИКОНА НА ОСНОВЕ АМОРФНОГО ГИДРИРОВАННОГО КРЕМНИЯ

О.А. Голикова, М.М. Мездригина,  
И.Н. Петров, М.М. Казанин,  
К.Л. Сорокина

Среди приложений аморфного гидрированного кремния ( $a - Si : H$ ) как фоточувствительного полупроводника весьма перспективным является создание мишней видикона на его основе. Согласно данным [1], такие видиконы представляют интерес для применений в однотрубочных цветных телевизионных камерах. Особенно следует отметить их термостабильность (до 100 °C). В сочетании с возможностью получения больших однородных поверхностей и относительной простотой приготовления, это делает использование  $a - Si : H$  в качестве материала мишней очень привлекательным. Однако требования к  $a - Si : H$  при этом достаточно высоки: основным показателем качества является низкая величина плотности локализованных состояний в щели подвижности. В последние годы авторами настоящей работы был получен и исследован  $a - Si : H$ , для которого эта величина составляла  $10^{16} \text{ эВ}^{-1}\text{см}^{-3}$  [2]. Использование трехэлектродной системы для ВЧ-разложения силаносодержащих смесей [3] и оптимизация режимов нанесения слоев  $a - Si : H$  позволили добиться дальнейшего снижения плотности состояний до уровня  $\leq 10^{15} \text{ эВ}^{-1}\text{см}^{-3}$ . Данные пленки не имеют выраженной столбчатой микроструктуры и содержат (6–12) ат. % водорода преимущественно в форме  $Si - H$  комплексов. Оптическая ширина запрещенной зоны (щели подвижности) составляет 1.7–1.8 эВ. Полученные пленки отличают высокая фоточувствительность и стабильность. На основе этого материала и были созданы мишени видикона и проведены работы по их исследованию.

Конструктивно мишень изготавливали тем же способом, как в [4]: путем последовательного нанесения на стеклянную подложку следующих слоев: ИТО,  $n^+$ -слой  $a - Si : H$ ,  $i^-$ -слой  $a - Si : H$ ,  $Sb_2S_3$ . Как известно, процесс формирования изображения требует от материала мишени не только высокой фоточувствительности ( $G_{\phi}/G_T$  не хуже  $10^4$  для  $\lambda = 625 \text{ нм}$  и при потоке  $\phi = 10^{15} \text{ см}^{-2}\text{s}^{-1}$ ), но и низкой темновой проводимости ( $G_T \sim 10^{-12} \Omega^{-1}\text{см}^{-1}$  при  $T=300 \text{ K}$ ) для достижения хорошего разрешения. Для удовлетворения этого критерия необходимо принять дополнительные меры, т.к. исходный собственный слой  $a - Si : H$ , напыленный в триодной системе, имел при  $T=300 \text{ K}$   $G_T \sim 10^{-10} \Omega^{-1}\text{см}^{-1}$  при энергии активации электропроводности  $\sim 0.9 \text{ эВ}$  и электронном характере проводимости. Понизить величину электропроводности можно путем „компенсации“ при введении атомов бора; именно такой слой подразумевается под обозначением  $i^-$ -слой.

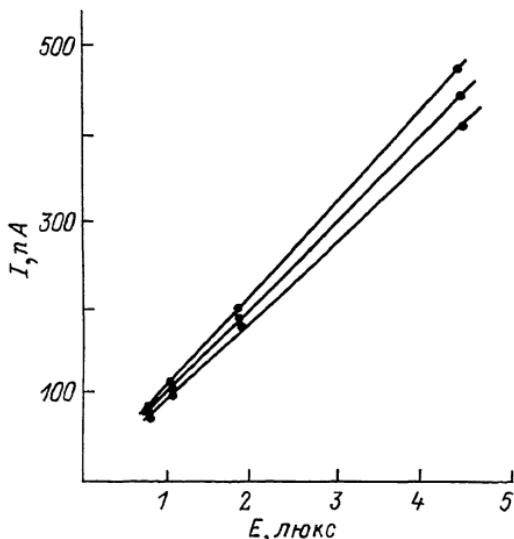


Рис. 1. Люкс-амперные характеристики для трех мишеней. Напряжение на мишени – 10 В.

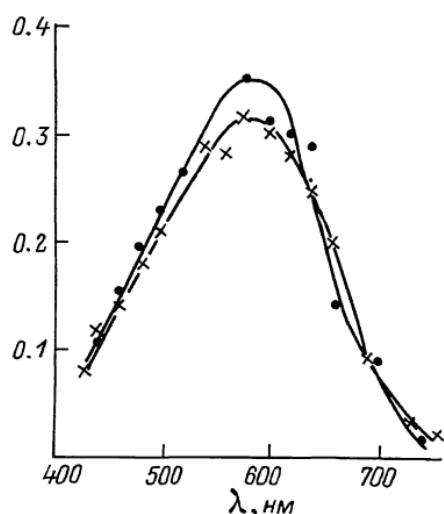


Рис. 2. Спектральные характеристики для двух мишеней.

Оптимизация характеристик этого слоя производилась за счет слабого легирования  $B$  методом ионной имплантации [5]; подбором параметров процесса удалось снизить величину  $\sigma_T$  (300 К) до значения  $\lesssim 10^{-11} \Omega^{-1} \text{см}^{-1}$  при сохранении относительной фоточувствительности ( $\sigma_\phi / \sigma_T \approx 10^4 - 10^5$ ). Легированный из газовой фазы путем добавления в газовую смесь фосфина  $n^+$ -слой характеризовался проводимостью  $\sigma_T$  (300 К)  $\sim 10^{-6} \Omega^{-1} \text{см}^{-1}$  и энергией ее активации  $\approx 0.35$  эВ.

На рис. 1, 2 представлены люксамперные и спектральные характеристики мишеней. Следует отметить, во-первых, хорошую воспроизводимость результатов от образца к образцу, во-вторых, соответствие этих результатов данным работы [4], причем величины тока сигнала превышают полученные при аналогичных условиях в [1]. Разрешающая способность полученных мишеней более 600 ТВ линий (диагональ изображения 16 мм), величины темнового тока – 10 нА (при напряжении на мишени 10 В).

Отметим также, что описанные мишины представляют интерес для исследований фотоэлектрических характеристик а – Si : H в режиме видикона [6], когда можно изучать ВАХ структур независимо от наличия микропор в слоях аморфных материалов, непосредственно изучать особенности транспорта дырок и др.

#### С п и ц о к    л и т е р а т у р ы

- [1] Shimizu I., Oda Sh., Saito K., Inoue E. // J. Appl. Phys. 1980. V. 51. N 12. P. 6422–6423.

- [2] Голикова О.А., Казанин М.М., Мездрова М.М., Сорокина К.Л., Феоктистов Н.А.// ФТП. 1986. Т. 20. № 10. С. 1912-1914.
- [3] Tanaka M., Ninomiya K., Nakamura K., Tsuda Sh., Nakamoto Sh., Ohnishi M., Kuwano Y. // Jap. J. Appl. Phys. 1988. V. 27. N 1. P. 14-19.
- [4] Ishioka S., Imaura Y., Takanashi Y., Kuzano Ch., Hirai T. // Jap. J. Appl. Phys. 1983. V. 22. Suppl. 22-1. P. 461-464.
- [5] Kalbitzer S., Muller G., Le Comber P.G., Spear W.E. // Phil. Mag. 1980. V. 41. N 4. P. 439-456.
- [6] Ода Ш., Томита Х., Шимизу И. В кн.: Аморфные полупроводники и приборы на их основе / Под ред. Й. Хамагава. М.: Металлургия, 1986, с. 132-143.

Физико-технический  
инstitut им. А.Ф. Иоффе  
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию  
5 октября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 4  
ОЗ

26 февраля 1989 г.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  
СТРУКТУРЫ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ  
ДЛЯ РАССЛАИВАЮЩИХСЯ СИСТЕМ

Е.В. Калашников, Н.М. Ганжерли,  
И.А. Маурер

При охлаждении расслаивающиеся бинарные жидкости с переходом через критические температуры претерпевают различные стадии превращений, описываемых спинодальным распадом [1].

Обычно выделяют раннюю стадию распада на фазы, когда флуктуации концентрации ведут себя как независимые и нарастают во времени по экспоненте, и позднюю [1, 2]. Процесс распада на ранней стадии контролируется диффузией компонентов [1]. На поздней стадии, когда пространственные размеры фаз достаточно велики, чтобы разрушить эту фазовую микрогетерогенность, включаются гравитационные эффекты, вызывающие гидродинамические течения [2]. Последующее развитие такого течения способно привести к возникновению конвективных ячеек, характер которых задается внешней геометрией в сочетании с вязкостью и взаимной диффузией бинарной жидкости [3]. При более низких температурах на системах со скрытым характером расслоения, таких как эвтектические, включаются конкурирующие механизмы кристаллизации [4].